

プロに学ぶ表面形状観察及び分析

日時:6月6日(金)13:00~15:00

場所:理系複合棟102室

講師:アルバック・ファイ 株式会社

星 孝弘 氏

株式会社 ニコンインストルメンツカンパニー

西川 孝 氏

主な内容:

13:00-14:00 X線光電子分光分析の原理と基礎

表面の組成や化学結合状態に関する情報が得られるX線光電子分光分析(ESCA: Electron Spectroscopy for Chemical Analysis、またはXPS: X-ray Photoelectron Spectroscopy)について解説する。

14:00-15:00 非接触三次元表面形状計測器の紹介

走査型光干渉計測技術による超高分解能非接触三次元表面形状計測システムを紹介する。

申込み

予約QRコードまたは
下記のサイトでご予約ください。

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=92

申込期限: 6/5(木) 15:00まで (以降は当日会場にて受付)



問い合わせ先

機器分析支援センター事務室(理系複合棟307室)

技術専門職員 儀間 真一

TEL: 895-8967 HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>